

# 真空コントローラつき溶媒回収型 ダイヤフラム真空ポンプシステム LABOPORT® SC 820 G



## 特長

- 4つの運転モード
- 溶媒の沸点を自動で正確に検知  
溶媒ライブラリ不要・混合溶媒に最適
- 吸気側トラップと排気側のコンデンサにより溶媒をより効率よく回収
- 高湿ガスに有効なガスバラスト搭載
- 腐食性溶媒に最適
- リモートコントローラによりドラフトチャンバー外から安全な操作可能
- タッチスクリーンディスプレイで簡単操作
- ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠  
II 3/-G Ex h II B+H2 T3 Gc

## 推奨アプリケーション

- ・エバポレータ・デシケーター/乾燥・脱気/脱泡・ろ過

## 製品仕様

排気速度[m <sup>3</sup> /h] @大気圧時	1,2
排気速度[L/min] @大気圧時	20
到達真空度[mbar abs.]	6,0
加圧圧力[bar]	0,1
電圧[V]	100-240
周波数[Hz]	50/60
保護等級	IP30
消費電力[W]	60
消費電流[A]	0,35 (240 V AC) 0,66 (100 V AC)
サーマルスイッチ、ヒューズ内蔵	

## 真空コントロールユニット/コントローラ

入カタイプ	USB-A (Bluetooth) USB-Mini/USB-C (ケーブル接続)
コントローラの電源	内臓バッテリーまたは 付属のワイヤレス充電を 使用
バッテリー耐久時間	最大8時間
操作方法	タッチパネル ボタン操作
重量 (kg)	コントローラ : 0.69 ドッキングステーション: 0.26
バッテリー	ニッケルメタルハイブリッド (Ni/Mh)

## 材質

ポンプヘッド	TFM™ PTFE
ダイヤフラム	PTFE コーティング
バルブ	FFKM

## その他の仕様

重量 (kg)	13.35
ホースコネクタ	吸入口：内径8~9.5mmのホースに適合 排気口：内径10mmのホースに適合
寸法 (mm)	真空ポンプシステム : 347 x 416 x 260 コントローラ : 162 x 96 x 51 ドッキングステーション: 96 x 88 x 101
対応可能ガス・環境温度 (°C)	+5 ~ +40

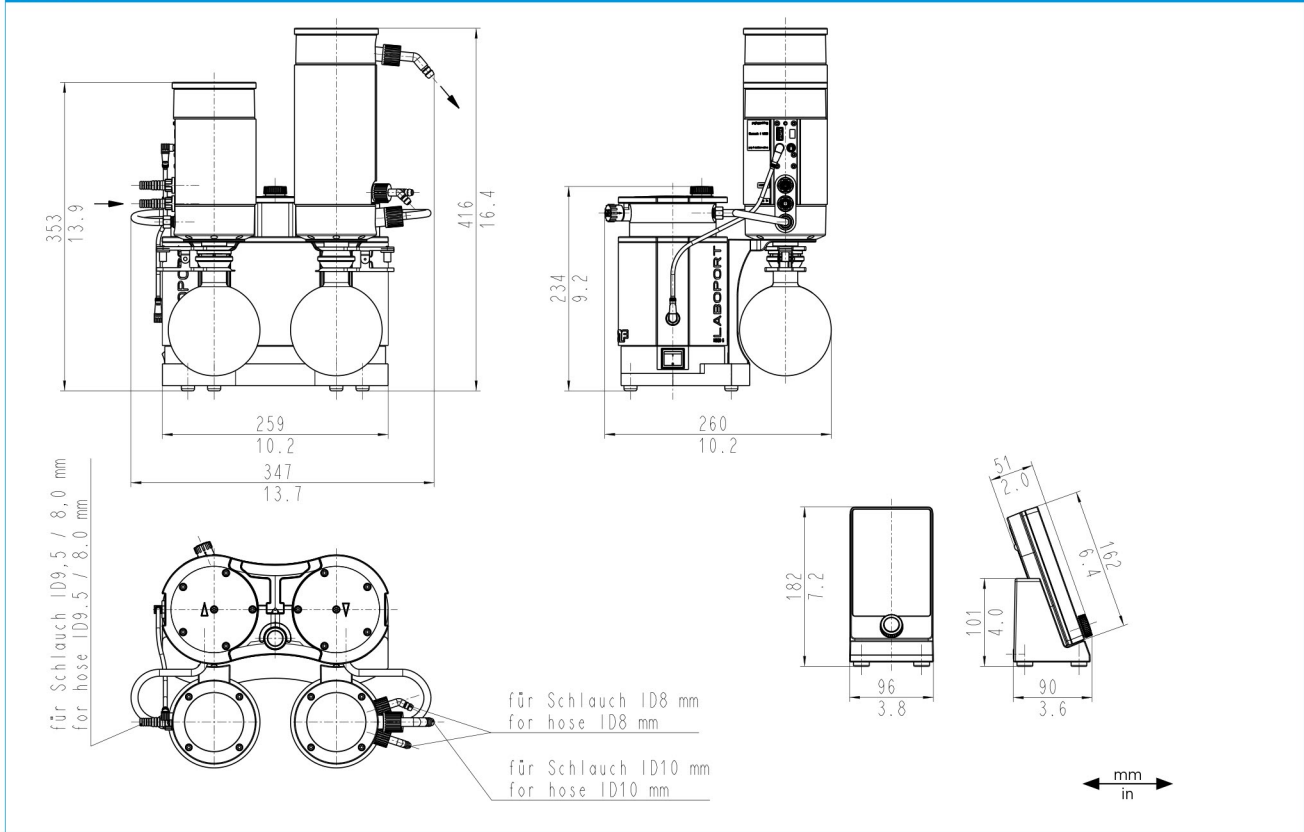
## スペアパーツ

スペアパーツ	ID
N820G用スペアパーツキット	331051
システム用サービスキット*	338823

\*331051のセット内容に加えてOリングが入ったシステム用のサービスキットです

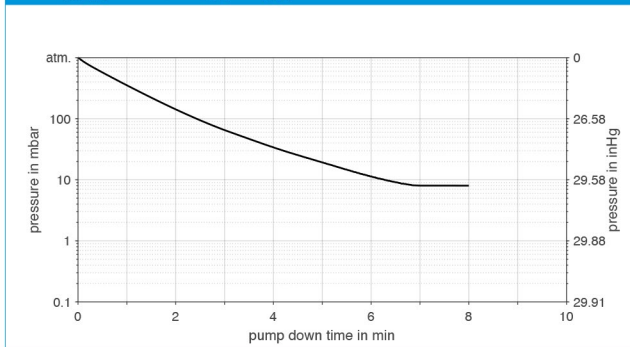
## 図面

### SC 820 G

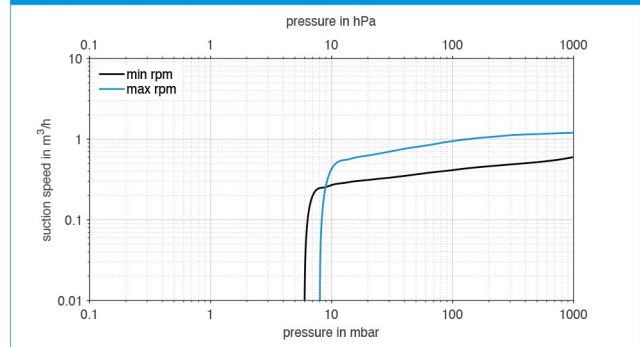


## 真空特性

### 20L 容器における減圧時間



### 最大/最小運転時における排気速度



アクセサリ	ID
セパレータフラスコ	047729
リークバルブ付き高性能コンデンサー	114855
ホースコネクタ+Oリング (FKM)	323609
ホースコネクタ PP (内径10mmのホースに適合)	026237
スクリーキャップ(赤) GL18 (ID : 026237のホースコネクタ用)	025980
ホースコネクタ PP (内径8mmのホースに適合)	025981

スクリーキャップ(赤) GL14 (ID : 025981のホースコネクタ用)	025982
ホースコネクタ用ジグ	316279
セパレータフラスコ用BGRホース (SC820 G用 x 1)	329998
高性能コンデンサー用BGRホース (SC820G用 x1)	317157
ドッキングステーション	336784
コントローラ用バッテリー	339004